



MSP-12S

マグネトロンスパッタ

大面積マグネトロンスパッタ装置

- 12インチウェハに対応する大面積回転試料ステージを搭載。
- 任意箇所のみを可動式φ50mmターゲットで低ランニングコスト・コーティング。
- 印加電圧500V以下でイオンダメージを軽減するマグネトロン方式を採用。
- 100 μ RPを採用し、排気時間・ガスコントロール性を向上。(MSP-12in比較)
- ウェハの出し入れは楽々の前方引き出し方式を採用。



株式会社 真空デバイス

〒311-4155 茨城県水戸市飯島町 1285-5

Tel: 029-212-7600 Fax: 029-212-7601

E-mail: device@shinkuu.co.jp

特 徴 ・ 仕 様

特 徴

- ★ MSP-12S は SEM 観察用イオンスパッタ成膜装置です。
- ★ 小面積ターゲットを使用。マグネトロン電極は、当社製 MSP-1S 形サイズでランニングコストを気にする必要がなくなりました。
- ★ 試料台の回転機構とターゲットのスライド機構を併用して特定箇所のみを成膜。
- ★ 低電圧でコーティングすることにより、デリケートなサンプルに用いても試料損傷がほとんどありません。
- ★ AUTO コーティングモードを装備。脱ガス・雰囲気ガス導入・コーティングまでを全自動で行います。
- ★ 前方引き出し式試料ステージで 12 インチウェハの取出しが楽になりました。
- ★ 排気系は RP10ℓ/min を採用。クリーンルーム用にスクロールポンプ (オプション) への変更も可能です。
- ★ 空気雰囲気において成膜純度を高める為にガス流量を制限するバイパス機能搭載。

仕 様

1. ターゲット : 直径 50mm マグネトロン型
2. 成膜対象金属 : Pt (標準) オプション (Au・Au-Pd・Pt-Pd・Cu)
3. 試料ステージ : 直径 300mm (または 12 インチも選択可能。)
4. ターゲットー試料間隔 : 40mm
5. チャンバーサイズ : 内径 330mm x 深さ 80mm
6. イオン化電圧/電流 : DC 0 ~ 500V / 0 ~ 50mA 電流計読み取り
7. タイマー : 0 ~ 1, 2, 3, 12, 30 / sec, min, hr 各自由設定. 電子タイマー
8. 排気系 : RP10ℓ/min
9. 真空度測定 : ピラニ真空計
10. 雰囲気ガス導入 : アルゴン又は窒素, 空気をニードルバルブ調節、電磁バルブ+バイパス排気管 ON/OFF 方式
11. 安全対策 : サーキットプロテクタスイッチ、及び系統別フェーズ付
12. 装置サイズ : 本体 W449mm x H427mm x D439mm 30kg
13. 電源 : 単層 AC 100 V, 15A アース線付 3 芯プラグ使用